DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2004 EPO. All rts. reserv.

16220617

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 11329748 A2 19991130 <No. of Patents: 002 >

ORGANIC EL(ELECTROLUMINESCENT) ELEMENT AND LIGHT EMITTING DEVICE

**USING IT** 

(English)

Patent Assignee: IDEMITSU KOSAN CO

Author (Inventor): TANAKA SHOSAKU; HOSOKAWA CHISHIO IPC: \*H05B-033/26; G09F-009/30; H05B-033/12; H05B-033/14

CA Abstract No: \*133(13)185328U;

Derwent WPI Acc No: \*G 00-081081; G 00-081081

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 11329748 A2 19991130 JP 98138326 A 19980520 (BASIC)

US 6107734 A 20000822 US 161503 A 19980928

Priority Data (No,Kind,Date): JP 98138326 A 19980520 US 161503 A 19980928

**BEST AVAILABLE COPY** 

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

\*\*Image available\*\* 06388101

ORGANIC EL(ELECTROLUMINESCENT) ELEMENT AND LIGHT EMITTING DEVICE **USING IT** 

PUB. NO.:

11-329748 [JP 11329748 A]

PUBLISHED:

November 30, 1999 (19991130)

INVENTOR(s): TANAKA SHOSAKU

HOSOKAWA CHISHIO

APPLICANT(s): IDEMITSU KOSAN CO LTD

APPL. NO.: FILED:

10-138326 [JP 98138326]

INTL CLASS:

May 20, 1998 (19980520) H05B-033/26; G09F-009/30; H05B-033/12; H05B-033/14

## **ABSTRACT**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic EL(electroluminescent) light emitting element that can restrain scanning line current and can allow a large and high precision display to be realized at low cost and also provide a light emitting device using it.

SOLUTION: This organic EL light emitting element 6 is formed from a transparent electrode 2, an opposite electrode 3 arranged opposite to the layers 4 conductive intermediate electrode 2, n transparent (1≤n≤100), and a pair of organic layers 5 which are interlaid between the transparent electrode 2 and the opposite electrode 3 interposing the intermediate conductive layer 4 between them and each of which contains at least an organic light emitting layer. This light emitting device 10 is composed by arranging a plurality of the organic EL light emitting elements 6 in a one-dimensional or two-dimensional form.

# (19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-329748

(43)公開日 平成11年(1999)11月30日

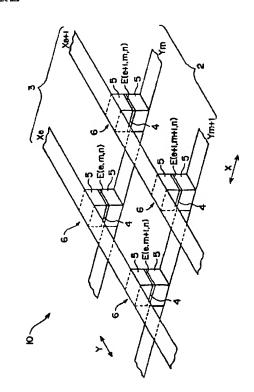
			••
(51) Int. Cl. 6	識別記号	FI	
H05B 33/26		H05B 33/26 Z	
G09F 9/30	365	G09F 9/30 365 D	
H05B 33/12		H05B 33/12 B	
33/14		33/14 A	
		審査請求 未請求 請求頃の数10 OL (全10)	i)
(21)出願番号	特願平10~138326	(71)出願人 000183646 出光興産株式会社	
(22)出顧日	平成10年(1998) 5月20日	東京都千代田区丸の内 3 丁 日 1 番 1 号	
		(72)発明者 田中 省作	
		鳥取県鳥取市湖山町南 3 丁目212-4	
		(72)発明者 細川 地潮	
		千葉県袖ケ浦市上泉1280番地	
		(74)代理人 弁理士 木下 實三 (外1名)	

# (54) 【発明の名称】有機EL発光素子およびそれを用いた発光装置

# (57)【要約】

【課題】 走査線電流を抑制し、大型かつ高精細ディスプレイを安価に実現できる有機EL発光素子および発光 装置を提供する。

【解決手段】 透明電極2と、この透明電極2に対向して配置された対向電極3と、n枚(1≦n≦100)の中間導電層4と、前記透明電極2と対向電極3との間に中間に中間導電層4を挟んで介在され少なくとも有機発光層を包含する有機層5とから有機EL発光素子6が形成されている。この有機EL発光素子6が一次元または二次元配列されて発光装置10が構成されている。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明電極と、この透明電極に対向して配 置された対向電極と、中間導電層と、前記透明電極と対 向電極との間に中間に前記中間導電層を挟んで介在され た複数の有機発光層とを含むことを特徴とする有機EL

【請求項2】 請求項1に記載の有機EL発光素子にお いて、前記中間導電層の数 n が、1≦ n ≤ 1 0 0 である ことを特徴とする有機BL発光素子。

いて、前記透明電極、中間導電層および対向電極が、平 面視上重なって積層されていることを特徴とする有機E L発光素子。

【請求項4】 請求項2に記載の有機EL発光素子にお いて、前記透明電極と一番目の中間導電層にて有機発光 層を介在した第一の単位発光素子と、n番目の中間導電 層と対向電極にて有機発光層を介在した第ヵの単位発光 素子とが、平面上並置されていることを特徴とする有機 EL発光素子。

【請求項5】 請求項2に記載の有機EL発光素子にお 20 いて、前記透明電極と一番目の中間導電層にて有機発光 層を介在した第一の単位発光素子と、n番目の中間導電 層と対向電極にて有機発光層を介在した第ヵの単位発光 案子とが、少なくとも整流性を保有することを特徴とす る有機EL発光素子。

【請求項6】 透明電極と、この透明電極に対向して配 置された対向電極と、中間導電層と、前記透明電極と対 向電極との間に中間に前記中間導電層を挟んで介在され た複数の有機発光層とを含む有機発光素子を、画素とし

【請求項7】 請求項6に記載の発光装置において、前 記中間導電層の数nが、1≤n≤100であることを特 徴とする発光装置。

【請求項8】 請求項7に記載の発光装置において、前 記透明電極、中間導電層および対向電極が、平面視上重 なって積層されていることを特徴とする発光装置。

【請求項9】 請求項7に記載の発光装置において、前 記透明電極と一番目の中間導電層にて有機発光層を介在 した第一の単位発光素子と、n番目の中間導電層と対向 40 料が開発されているが、その効率は最大でも $\eta=1$ 0 c 電極にて有機発光層を介在した第nの単位発光素子と が、平面上並置されていることを特徴とする発光装置。

【請求項10】 請求項7に記載の発光装置において、 前記透明電極と一番目の中間導電層にて有機発光層を介 在した第一の単位発光素子と、n番目の中間導電層と対 向電極にて有機発光層を介在した第nの単位発光素子と が、少なくとも整流性を保有することを特徴とする発光 装置。

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機EL(エレク トロルミネッセンス)発光素子およびそれを用いた発光 装置に関する。詳しくは、大型かつ高精細ディスプレイ を実現するための有機EL発光素子および発光装置に関 する。

# [0002]

【背景支術】発光デバイスとして有機物を用いた有機E 【請求項3】 請求項2に記載の有機EL発光素子にお 10 L発光素子が注目され、最近では、ディスプレイなどに 利用されてきている。図6 (A) (B) は、有機EL発 光素子を用いた従来のXYマトリックス型発光装置を示 している。このXYマトリックス型発光装置は、ストラ イプ状に形成されたX電極ラインXc-2, Xc-1, Xe, Xe+1…と、このX電極ラインXc-2, Xe -1, Xe, Xe+1…に対して直交配置されたストラ イプ状のY電極ラインYm-1, Ym, Ym+1…と、 これらX電極ラインXe-2, Xe-1, Xe, Xe+ 1…およびY電極ラインYm-1, Ym, Ym+1…の 間に介在され少なくとも有機発光層を含む有機層でとか ら構成されている。

【0003】この構造において、XY座標のうち、任意 の座標位置にある画素を発光させるには、たとえば、X 方向を走査ラインとすると、まず、 X 電極ラインX e ー 2, Xe-1, Xe, Xe+1…の一本を選択して0V の電圧を印加し、他のX電極ラインXe-2,Xe-1, Xe, Xe+1…に負電圧を印加する。一方、選択 したX電極ラインXe-2, Xe-1, Xc, Xe+1 …の発光させたい画素に対応してY方向信号ラインであ て、一次元または二次元配列したことを特徴とする発光 30 るY電極ラインYm-1, Ym, Y+1…の一本に正電 圧を印加し、発光させない画素に対応するY電極ライン Ym-1, Ym, Y+1…に負電圧または0Vを印加す る。これにより、得ようとする座標の画素を発光させる ことができる。なお、X電極ラインを負極、Y電極ライ ンを正極として考えたが、これ以外でも同様に駆動する ことができ得る。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、有機EL発 光素子に用いられる有機発光材料については、種々の材  $d/A\sim 17cd/A$ であった。このため、10インチ 以上の大面積や、闽素数が(320×240)以上の高 精細ディスプレイを実現しようとすると、次の点が問題 となってきた。

(N>100) となる。このため、瞬間的には求める輝 度Lo(nit)のN倍、すなわち、LN(nit)が 必要である。このとき、必要な電流密度は、

 $I = I. N/\eta (A/m^2) = (I. N/\eta) \times 10^{-4} (A/c m^2)$ =  $(I. N/\eta) \times 10^{-1} (mA/c m^2)$  3

である。従って、求める輝度Lo=200 (nit)と [0006] した場合、次の表1の電流密度が必要である。 (η=1 【表1】 0 c d / A のとき)

N	I [mA/cm²]	走査線電流(走査線面積 0.6 cm²のとき)[mA]
100	200	<b>≒</b> 120
200	400	<b>÷</b> 240
300	600	<b>⇒</b> 360
400	800	<b>÷</b> 480
500	1000	<b>⇒</b> 600

【0007】②上記のように大電流密度が必要となるの で、(a)走査ライン、信号ラインの抵抗により電圧降 下が大きく、消費電力が増大する。(b)大電流を注入 できるような駆動回路が必要となり、そのため、駆動回 路の大型化により薄型ディスプレイが実現できない。 ③しかも、高精細になるにつれ、走査ラインおよび信号 ラインが細線化し高抵抗化するため、CR時定数が大き くなり、素子の応答が遅れ、動画像を得る場合の支障と

しては輝度が300nit以上必要となるので、これら の問題はさらに不可避となる。

【0008】なお、上述の問題を解決できるものとし て、EP0717445号が知られている。このEPO 717445号では、ポリシリコンTFTを用いTFT 駆動した有機EL発光装置を開示している。画素の大き さ200μm角、 画素数1000×1000 ディスプ レイを実現しようとすると、単純マトリックス方式では 走査線電流が2A/cm²となり、さらに走査線抵抗、 信号線抵抗による電圧降下によって実質的には駆動でき 30 ないことを開示している。この特許では、TFTを用い て、この問題を解決しようとしている。しかしながら、 ボリシリコンTFTのプロセスは長く、また、製造コス トも高い。従って、ディスプレイも高価となるためメリ ットは少ない。

【0009】本発明の目的は、走査線電流を抑制し、大 型かつ高精細ディスプレイを安価に実現できる有機EL 発光素子および発光装置を提供することにある。

#### [0010]

子は、透明電極と、この透明電極に対向して配置された 対向電極と、中間導電層と、前記透明電極と対向電極と の間に中間に前記中間導電層を挟んで介在された複数の 有機発光層とを含むことを特徴とする。本発明の発光装 置は、上記有機EL発光素子を、画素として、一次元ま たは二次元配列したことを特徴とする。ここで、各両索 の中間導電層は、隣接する画素の中間導電層から分離さ れているだけでなく、電源からも分離されている。ま た、各画素中の中間導電層の数nは、任意であるが、現 実的には100以下、つまり、 $1 \le n \le 100$ である。

【0011】従って、本発明における有機EL発光素子 は、中間に中間導電層を挟んで複数の有機発光層が直列 接続された構成となっているから、たとえば、従来のX Yマトリックス型発光装置を構成する画素の駆動電圧を Vo、駆動電流をio、画素の静電容量をCoとする と、本発明の画素 (n個の有機発光層、n-1の中間導 電層を保有)の駅動電圧はnVo、駆動電流はio/ n、静電容量はCo/nとなる。ただし、画素の輝度は 従来と同一、単位素子(有機発光層を中間導電層および ④さらに、テレビジョンを実現したいというニーズに対 20 電極で挟んだ単位素子)は従来のXYマトリックスの両 素素子と同じとする。

> 【0012】換含すると、画素の輝度をn倍にしようと すると、従来のXYマトリックス型発光装置では、駆動 電流をn倍にする必要があるが、本発明では、駆動電圧 がn倍になるものの、駆動電流は同じでよい。つまり、 輝度を同一とすると、本願発明では、電圧は従来のn倍 になるものの、電流が従来の1/nでよいため、従来問 題となっていた走査、信号ラインの抵抗による電圧降下 は1/nとなる。よって、次の効果が期待できる。

> 【0013】従来の発光装置では、走査線電流が大き く、そのため電圧降下が大きく、消費電力の増大をもた らすこと、また、高精細、大面積の発光装置では走査線 電流が1A近くとなり、実質的にはドライバーICで駆 動できないことが問題となっていた。しかし、本発明で は、走査線電流は従来の1/nとなり、消費電力も減少 するので、より大面積かつ高精細、たとえば、12イン チSVGA (画案数800×600、画素ピッチ110 μm×330μm) 以上も可能である。

【0014】また、画素表示を行うためには、画素が高 【課題を解決するための手段】本発明の有機EL発光素 40 速に応答することが必要であるが、従来は配線抵抗Ro と駆動時に関係する静電容量C1との積で定まる時定数  $\tau o = R o \cdot C 1$ が大きく、数 $\mu S \sim 2 10 \mu S$ となっ ていた。このため、駆動波形の立ち上がり、立ち下がり が遅れ、動画表示に支障が出ていた。本発明では、Co が1/nとなり、さらに駆動時に関係する静電容量C1 も1/nとなる。従って、時定数は $\tau o = Ro \cdot (C1)$ /n)となり、高速に応答し、動画表示も高品質で行う ことができる。なお、C1はCoと同一ではなく、駆動 方式にもよるが、ClaCo×(縦画素数)程度とな 50 る。

【0015】以上において、有機EL発光素子を構成す る透明電極、中間導電層および対向電極の配列構成につ いては、平面視上各画素に対して重なって積層されてい る構成でもよく、あるいは、透明電極と一番目の中間導 電層にて有機発光層を介在した第一の単位発光素子と、 n番目の中間導電層と対向電極にて有機発光層を介在し た第nの単位発光素子とが、平面上並置されている構成 でもよい。特に、前者の構成の場合には、後者の構成に 比べ、画素を高密度化できる。

有機発光層を介在した第一の単位発光素子と、n番目の 中間導電層と対向電極にて有機発光層を介在した第nの 単位発光素子とが、少なくとも整流性を保有することが 望ましい。ここで、整流性を、好ましくは10゚以上、 より好ましくは10′以上とすれば、クロストークを防 ぐことが可能となる。本発明では、中間導電層を保有す る単位発光素子を多段で連結したため、整流性が得やす くなっている。従来の素子は、一個の単位発光素子から なっているため、整流性が不良な素子が生じやすく、ク ロストークが生じやすいという問題があった。

【0017】ちなみに、本発明の構成に近い技術とし て、WO95/06400号が知られている。このWO 95/06400号は、第一の有機発光素子と第二の有 機発光素子とを積層して、第一の発光色と第二の発光色 を混色する、または、ハイカラー化するための効果を得 るため考えられたものであるが、各有機発光素子にそれ ぞれ個別に電圧を印加した構成であるため、本発明の中 間導電層を保有する構成とは異なる。しかも、本発明の 中間導電層を中間に挟んだ有機発光層の構成に基づく効 果についても一切示されていない。

## [0018]

【発明の実施の形態】 [第1実施形態] 図1は第1実施 形態の概略構成を示している。同図に示すように、第1 実施形態の発光装置10は、図示省略のガラス基板上に 形成された陽極となる透明電極2と、この透明電極2に 対向して配置された陰極となる対向電極3と、n枚(1 ≦ n ≤ 1 0 0)の中間導電層 4 と、前記透明電極 2 と対 向電極3との間に中間に前記中間導電層4を挟んで介在 され少なくとも有機発光層を含有する複数の有機層5と を含む有機EL発光素子6を画素として備え、この画案 40 (有機EL発光素子6)が二次元配列、つまり、Xおよ びY方向に沿って配列されている。つまり、XYマトリ ックス型発光装置を構成している。

【0019】具体的には、透明電極2は、透光性を有 し、互いに平行にかつ一定間隔おきに並設された複数の Y電極ラインYm、Ym+1…から構成されている。対 向電極3は、Y電極ラインYm、Ym+1…に対して直 交して、互いに平行にかつ一定問隔おきに並設された複 数のX電極ラインXe、Xc+1…から構成されてい る。中間導電層4は、透光性を備えるとともに、Y電極 50 より具体化して示している。図3はその一部を拡大した

6 ラインYm, Ym+1…とX電極ラインXe, Xe+1 …との交差する箇所で、かつ、これらの間にそれぞれ1 枚配置されている。これを、E (e, m, n), E (e, m+1, n), E (e+1, m, n), E (e+ 1, m+1, n) …とする。なお、nは各画素6中に介 在された中間導電層の数を表し、本実施形態では「1」 である。また、各画素6中の中間導電層E(c,m, n), E (e, m+1, n), E (e+1, m, n), E (e+1, m+1, n)…は、隣接する画素6の中間 【0016】また、透明電極と一番目の中間導電層にて 10 導電層E(e, m, n), E(e, m+1, n), E (e+1, m, n), E (c+1, m+1, n) …から 分離されているとともに、電極2, 3に接続される電源 からも分離されている。もとより、中間導電層E(e, m, n), E (e, m+1, n), E (e+1, m, n), E(c+1, m+1, n)…を単独でアドレスす る配線は備えていない。中間導電層4は、一方の主表面 側には正孔を注入でき、他方の主表面側には電子を注入 でき、かつ、層内には略等電位を保つ層と定義できる。 この定義にあてはまるならば、各種透明性の半導体、金 20 属を用いることができるとともに、半導体/金属の組合 せも川いることができる。有機層5は、Y電極ラインY m, Ym+1…とX電極ラインXe, Xc+1…との交 差する箇所(各画案中)において、Y電極ラインYm, Ym+1…と中間導電層E (e, m, n), E (e, m +1, n), E (e+1, m, n), E (e+1, m+1)1, n) …との間、中間導電層E (e, m, n), E (e, m+1, n), E (e+1, m, n), E (e+1, m, n)1, m+1, n) …とX電極ラインXe, Xe+1…と の間にそれぞれ介在されている。

【0020】ここで、各電極2、3および中間導電層4 間に少なくとも有機発光層を含有する有機層5が介在し てなる部分を単位素子と定義すると、本実施形態では、 単位案子が平面視上重なるように積層されている。つま り、透明電極2、中間導電層4および対向電極3が、平 **面視上各画素に対して重なるように積層されている。さ** らに、これらの単位素子は、整流性を有している。整流 比としては、好ましくは10゚以上、より好ましくは1 0'以上である。また、単位素子としては、同じ発光色 を示すものが好ましい。さらに、有機層 5 を構成する各 層(たとえば、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子 **注入層)の材料については、同一材料によって構成され** ているのが好ましい。これは、製造がしやすくなり、さ らに製膜条件が一定であるため、画素の欠陥が少なくな る効果がある。また、透明電極2上に直接位置する単位 素子にリーク不良が存在したとしても、積層される単位 素子によりリーク不良が解消される効果があるが、その 効果の面でも材料が同一で製膜条件が一定である方が、 より効果を得やすい。

[0021] 図2は、上記図1の発光装置10の断面を

拡大図である。これらの図に示すように、透明電極2お よび基板 (図示省略) 上に層間絶縁膜7が形成されてい る。層間絶縁膜7は、絶縁性または半導性の膜であり、 非発光素子部分の一部分となっている。 層間絶縁膜7は その断差部分が急であり、これにより、中間導電層4を 相互に分離している。層間絶縁膜7としては、断差加工 ができる絶縁性膜、無機酸化物膜または無機窒化膜、具 体的にはSiOx  $(1 \le x \le 2)$ , SiNx  $(1/2 \le$ x≤4/3), SiON, SiAION, SiOF&& である。別の好ましい絶縁性膜は高分子膜である。具体 10 製膜できるIn-Zn-〇酸化物膜である。他に、非晶 的には、ポリイミド、ポリアクリレート、ポリキノリ ン、ポリシロキサン、ポリシランなどである。絶縁性膜 の他にも半導体膜であっても両素分離ができる絶縁性が あればよい。好ましい比抵抗は、 $10^{11}\Omega \cdot cm \sim 10^{11}$  $^{\circ}\Omega \cdot c m \tau \delta \delta$  .  $c \in \mathcal{L} \mathcal{A} \mathcal{A} \cdot \alpha - S i$  .  $\alpha - S i C$  . α-SiNなどでもよい。

【0022】ところで、上述した発光装置10の製造方 法については、各種考えられるが、好ましい具体例とし ては次のものが挙げられる。

- (1)透明電極の製膜およびパターン加工
- (2) 段差を与える層間絶縁膜の製膜およびパターン加 I.
- (3) 有機発光層を含む有機層の製膜((4)を挟んで n+1回繰り返し)
- (4) 中間導電層の製膜
- (5) 対向電極の作製((3)の製膜後に作製)
- (6) 封止工程

従って、たとえば、(3) を2回繰り返す時は(1) →  $(2) \to (3) \to (4) \to (3) \to (5) \to (6)$  とな

【0023】以上が本製造方法の製造工程であるが、従 来の素子の製造方法に比べ、(2)および(4)の工程 が異なる。また、(3)の工程を繰り返すところが異な っている。また、本製造方法は、層間絶縁膜の段差を急 にするところが必須であり、その角度は好ましくは70 5 nmの膜厚で製膜された中間導電層が段差により断線 され、隣接する画素の中間導電層が互いに分離される。 また、面発光素子(一画素)についても、中間導電層が 対向電極や透明電極より分離されていることを保障す

【0024】中間導電層としては、層内を略等電位に保 つとともに、一方の主表面より正孔を、他方の主表面よ り電子を注入できるものなら各種用いることができる。 好ましいものを列挙すると、

# ①超薄膜金属/透明電極

②電子輸送性化合物と電子注入性化合物の混合層/透明 電極

③炭素化合物とアルカリ金属の混合層/透明電極

④正孔導電性有機層/電子導電性有機層

⑤P型半導体/N型半導体

⑥P型導電性高分子/N型半導体

などである。さらに、一方の面が正孔注入性であり、か つ、他方の面が電子注入性であれば、薄膜金属、透明電 極、電子輸送性化合物と電子注入性化合物の混合層、正 孔導電性有機層、PまたはN型半導体など①~⑥の中間 導電層として用いられるものの中より組み合わせれば、 より好ましく用いることができる。

【0025】上記透明電極で特に好ましいのは、低温で 質ITO膜も好ましい。好ましい超薄膜金属は、電子注 入性であるMg:Ag合金、AI:Li合金、Mg:L i 合金などである。好ましい電子輸送性化合物は、オキ レンの金属錯体または含N素環化合物である。好ましい 電子注入性化合物は、アルカリ金属、アルカリ土類金 属、希土類金属およびこれらを含有する化合物である。 たとえば、BaO, SrO, Li2O, LiCI, Li F, MgF, MgO, CaF, などが好ましい電子注入 性化合物である。好ましいP型半導体は、P型α-S i, P型Si, P型CdTe, P型CuOなどである。 好ましいN型半導体は、N型α-Si, N型Si, N型 CdS, N型ZnSなどである。P型またはN型の導電 性高分子として、好ましいものは、ポリアリーレンピニ レン、ボリチェニレンピニレンなどである。

【0026】 [第2実施形態] 図4は第2実施形態の概 略構成を示している。同図に示すように、第2実施形態 の発光装置20は、3つの単位索子(1)(2)(3) が平面視上、並置されている構成である。Y電極ライン Ymより延長され接続されている電極Y'は、その上部 30 の中間導電層 E (e, m, 1) との間に有機発光層を有 する有機層5を介在し、単位素子(1)を構成してい る。中間導電層E(c, m, 1)は、並置された単位素 子(2)の下部にある中間導電層 E(e, m, 1)と接 統されている。中間導電層E(e, m, 1)は、その上 部にある中間導電層E(c,m,2)との間に有機発光 層を有する有機層5を介在し、単位素子(2)を構成し ている。中間導電層E(e,m,2)は、並置される単 位素子(3)の下部にある中間導電層E(e.m.2) と接続されている。中間導電層E(e, m, 2)は、そ 40 の上部のX電極ラインXeとの間に有機発光層を有する 有機層5を介在し、単位素子(3)を構成している。な お、これらの単位素子(1)(2)(3)については整 流性を備える。

【0027】従って、この第2実施形態の構成において も、X電極ラインYmより延長された電極Y'とX電極 ラインXeとの間に、2枚の中間導電層E(e,m, 1)、E(e, m, 2) が介在され、これらの間に有機 発光層を有する有機層 5 が介在されているから、つま り、電極Y'とX電極ラインXeとの間に、3つの有機 50 層 5 が中間に中間導電層 E (e, m, 1)、 E (e,

m、2) を挟んで直列に接続されているから、第1実施 形態と同等な効果が期待できる。

#### [0028]

【実施例】 [実施例1]  $25 \text{mm} \times 75 \text{mm} \times 1.1 \text{m}$  mのサイズのガラス基板上にITO (インジウムチンオキサイド) 電極を120 nm 製膜してあるものを透明支持基板とした。このITOを $110 \mu \text{m}$ ピッチ、 $90 \mu \text{m}$  m幅のストライプ状に加工した。ストライプの長手方向は20 mm、本数は600 本である。次に、層間絶縁膜として透明アクリレート樹脂(新日本製鉄化学社製)で 10 m ある100 m をスピンコートにて100 m にの後、この後、この基板を100 m にの温度で加熱し、100 m との後、この後、この温度で加熱し、100 m とりからなる層間絶縁膜を熱硬化した。

【0029】次に、このV259層上にフォトレジストを製膜し、図5(A)のような開口パターンが残るようにフォトマスクを通し露光、現像した。さらに、この基板を80℃の温度で1時間、乾燥した後、図5(A)の形状のフォトレジストをマスクとして酸素ガスを用いた反応性イオンエッチングを行い、開口部の層間絶縁膜を除去した。得られたものは図5(B)の断面をもつ基板 20である。なお、上面形状については図5(C)参照。

【0030】次に、この基板をイソプロピルアルコール中にて超音波洗浄を5分行い、さらに紫外線とオゾンを併用した洗浄を30分行った。この透明支持基板を真空蒸着装置に固定し、3つの抵抗加熱ボートには、MTD  $\Lambda TA(4,4',4''-トリス {N-(3-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ} トリフェニルアミン)とNPD(N,N'-ジー(1-ナフチル)-N,N'-ジフェニルー4,4'-ベンジジン)と<math>A1q(8-$ ヒドロキシキノリンのA1錯体)をそれぞれ入れた。また、金属Liの蒸音源を用意した。真空蒸音装置を $1\times10^{-1}$ まで排気した。

【0031】次に、MTDATA入りのボートを加熱し、膜厚120nmの正孔注人層を製膜した。次に、NPD入りのボートを加熱し、膜厚10nmの正孔輸送層を製膜した。次に、Alq入りボートを加熱し、膜厚40nmの発光層を製膜し、さらに、金属しiとAlqを1:1のモル比で同時蒸着した。このAlq:Li層は電子注入層として働くが、中間導電層の一部として考えてもよく、発光層への電子注入を行う。

【0032】以上の製膜を行った基板(図5(D)に示す基板)を真空蒸着用の槽よりこの真空槽に連結されているスパッタリング用の真空槽に移動した。そして、中間導電層の一部として1n-2n-0を11n 無関した。1n/(1n/2n) で表される原子比0.83の1n-2n-0スパッタリングターゲットを用い、スパッタリング出力1.2 W/c  $m^{\prime}$ 、A  $r:O_{i}$ の体積比1000:1の混合ガスを雰囲気として製膜した。

【0033】次に、以上の製膜を終えた基板を真空蒸着 用の槽に戻し、MTDATA入りポートを加熱し、膜厚 50

 $120\,\mathrm{nm}$ の正孔注入層を製膜した。次に、NPD入りのボートを加熱し、膜厚 $10\,\mathrm{nm}$ の正孔輸送層を製膜した。次に、AI $\mathrm{q}$ 入りボートを加熱し、膜厚 $40\,\mathrm{nm}$ の発光層を製膜し、さらに、金属LiとAI $\mathrm{q}$ を1:1のモル比で同時蒸着した。最後に、Inを陰極用蒸着マスク(閉口ストライプパターンは、ITOストライプに垂直となるように $400\,\mu\mathrm{m}$ ピッチ、閉口幅 $300\,\mu\mathrm{m}$ で20本設けられている。)をかけて $1.8\,\mu\mathrm{m}$ の膜厚で製膜し、陰極とした。作製された発光素子群(発光装置)の断面は図 $5(\mathrm{E})$ で示されたものである。

【0034】以上で作製を終えたが、この発光素子群の 陰極である I n ストライプ全でを0 電位に、陽極である I T O ストライプ全でに15 V を印加し、中間導電層に は何も結合しなかったところ、電流密度3 m A/cm'、輝度210 n i t を得た。発光効率は7 c d/A であった。

【0035】 [比較例1] 比較例1は中間導電層がない場合である。実施例1と同様に素子群を作製した。ただし、In-Zn-O中間導電層および2回目の正孔注入層、正孔輸送層、発光層の蒸着を省略し、従来の構成の素子群を作製した。発光素子群の陰極であるInストライプ全てに7.35Vを印加したところ、電流密度3mA/cm²、輝度100nitを得た。発光効率は3.37cd/Aであった。以上のことから、実施例1の素子は、電圧が比較例1に対して約2倍となるが、発光効率が約2倍となり、高輝度化が可能なことが判る。

【0036】 [実施例2] 実施例2は中間導電層が2枚の場合である。実施例1と同様にして2回目のLi:Alq層まで蒸着した。以上の製膜を行った基板を真空蒸着用の槽よりこの真空槽に連結されているスパッタリング用の真空槽に再び移動した。そして、中間導電層の一部としてIn-Zn-Oを10nm製膜した。<math>In/(In+Zn)で表される電子比0.83のIn-Zn-Oスパッタリングターゲットを用いスパッタリング出力1.2<math>W/cm、 $\Lambda r:O$ ,の体積比1000:1の混合ガスを雰囲気として製膜した。

【0037】次に、以上の製膜を終えた基板を真空蒸着 用の槽に戻し、MTDATA入りボートを加熱し、膜厚 120 nmの正孔注入層を製膜した。次に、NPD入りボートを加熱し、膜厚 120 nmの正孔輸送層を製膜した。次に、Alq入りボートを加熱し、膜厚 120 nmの発光層を製膜し、さらに、金属し 120 に 120

【0038】以上で作製を終えたが、この発光素子群の 陰極であるInストライプ全てを0電位に、陽極である 11

ITOストライプ全てに23Vを印加し、2枚の中間導 電層には何も結合しなかったところ、電流密度3mA/ cm'、輝度303nitを得た。発光効率は10.1 cd/Aであった。以上のように、この実施例2では、 比較例1の素子に比べて、電圧は約3倍であるが、輝度 が3倍、発光効率も約3倍の高輝度化素子が作製でき た。なお、以上の実施例では、全面発光の試験例を示し たが、陽極を信号線、陰極を走査線として単純マトリッ クスによる線順次駆動できることも確認している。従来 の発光装置に比較して、走査線電流を同じにしたとき、 実施例1、実施例2の発光装置で得られる輝度はそれぞ れ2.02、2.95倍であり、高輝度化することがで きた。

【0039】 [実施例3] 実施例3は中間導電層がM g:Agの超薄膜/In-Zn-O導線性酸化物膜の例 である。実施例1と同様にして素子を作製した。ただ し、Alg:Li/ln-Zn-O導線性酸化物膜の構 成の中間導電膜層のかわりに、Mg:Agの超薄膜/I n-Zn-O導線性酸化物膜を用いたところが異なっ た。Mg:Agは、膜厚8nmであり、同時蒸消により 20 ングターゲットを用いスパッタリング出力<math>1.2W/c形成した。この中間導電層は透過率が約60%であっ た。この発光索子群の陰極ストライプ全てを 0 電位に、 陽極であるITOストライプ全てに15Vを印加し、中 間導電層には何も結合しなかったところ、電流密度3m A/cm<sup>1</sup>、輝度156nitを得た。発光効率は5. 2 c d/Aであった。

【0040】以上のように、透過率が金属超薄膜を利用 した場合には、比較例1の素子に比べ約2倍までいかな いが、高輝度化した。電子注入層と電子注入性化合物の 混合層は透明性が高いので、実施例1の素子の方が優れ 30 ていた。このように、透過率が60%より大きい透明か つ正孔も電子も注入できる中間導電層を用いる方が好ま しいことが判明した。

【0041】 [実施例4] 実施例4は中間導電層を保有 する面発光光源の例である。 2 5 mm× 7 5 mm× 1. 1mmのサイズのガラス基板上にITO(インジウムチ ンオキサイド)電極を120nm製膜してあるものを透 明支持基板とした。このITOを25mm×30mmの 形状にパターン加工した。次に、層間絶縁膜として透明 アクリレート樹脂製 (新日本製鉄化学社製) であるV2 40 た。発光素子群の陰極を0電位に、陽極であるITOに 59をスピンコートにて $1.2 \mu$ mの膜厚で製膜した。 この後、この基板を200℃の温度で加熱し、V259 からなる層間絶縁膜を熱硬化した。

【0042】次に、このV259層上にフォトレジスト を製膜し、20mm×25mmの開口パターンが残るよ うにフォトマスクを通し露光、現像した。さらに、この 基板を80℃の温度で1時間、乾燥した後、フォトレジ ストをマスクとして酸素ガスを用いた反応性イオンエッ チングを行い、開口部の層間絶縁膜を除去した。次に、 この基板をイソプロピルアルコール中にて超音波洗浄を 50 ところ、寿命は1300時間に伸びた。初期輝度400

5分行い、さらに、紫外線とオゾンを併用した洗浄を3 0分行った。

【0043】この透明支持基板上に共役系ポリマーであ るポリ(2-メトキシ…5-(2-エチルヘキシルオキ シ) -1、4-フェニレンピニレン)、(MEII-PP V) を文献 (Synthetic Metal誌 第6 6巻、75頁、1994年)に従い合成した。MEH-PPVの1. 5重量%のキシレン溶液より発光層を12 0 nm製膜した。これを真空中で80℃で乾燥し、さら に、この層の上にAlq(8-ヒドロキシキノリンのA 10 1錯体)と金属しiの1:1の層を電子注入層として2 Onm、真空蒸着した。このAlq:Li層は電子注入 屑として働くが、中間導電層の一部として考えてもよ く、発光層への電子注入を行う。

【0044】以上の製膜を行った基板を真空蒸着用の槽 よりこの真空槽に連結されているスパッタリング用の真 空槽に移動した。そして、中間導電層の一部としてIn - Zn-Oを11nm製膜した。In/(In+Zn) で表される原子比0.83のIn-Zn-Oスパッタリ m'、Ar:O,の体積比1000:1の混合ガスを雰囲 気をして製膜した。

【0045】次に、以上の製膜を終えた基板上にさらに MEH-PPVの1. 5 重量%のキシレン溶液より発光 層を120mm製膜した。これを真空中80℃で乾燥 し、さらに、この層の上にAIa(8-ヒドロキシキノ リンのA 1 錯体)と金属Liの1:1の層を電子注入層 として20nm、真空蒸着した。金属LiとAlqを 1:1のモル比で同時蒸着した。最後に、1nを陰極用 蒸着マスクをかけて 1.  $7 \mu$  mの膜厚で製膜し、陰極と した。以上で作製を終えたが、この面発光素子の陰極を 0電位に、陽極である ITOに 11 V を印加し、中間導 電層には何も結合しなかったところ、電流密度30mA /cm'、輝度1400nitを得た。発光効率は4. 7 c d / A であった。

【0046】 [比較例2] 比較例2は従来の面状発光素 子の場合である。実施例4と同様に素子群を作製した。 ただし、 In-Zn-O中間導電層および2回目の発光 層、電子注入層を省略し、従来の構成の素子を作製し 5. 2 V を印加したところ、電流密度 3 0 m A / c m'、輝度750nitを得た。発光効率は2.5cd /Aであった。以上のことから、実施例4の案子は、比 較例2に比べ、電圧が約2倍となるが、発光効率が略2 倍近くとなり、低電圧で高輝度化が可能なことが判る。 【0047】 [従来発光素子の寿命と本発明素子の寿命 との比較〕初期200nitで定電流駆動で寿命試験を 行った。比較例2の素子の寿命は500時間であった。 実施例4の本発明の素子を同じ輝度で寿命試験を行った

nitで定電流駅動で寿命試験を行ったところ、比較例 2に対して実施例4の素子の輝度が2倍のとき、寿命は 470時間で同等であった。従って、本発明は、高輝度 で同等の寿命を得ることができ、同等の輝度では著しく 長寿命となることが判る。

【0.048】なお、本発明は、前記実施形態に限定されるものでなく、本発明の目的を達成できる他の構成を含む。たとえば、第1 および第2 実施形態では、画素(有機EL発光素子6)を二次元配列したが、X またはY 方向に沿って一列に配列、つまり、一次元配列でもよい。また、第1 実施形態では8 画素中に1 つの中間導電層4 を、また、第2 実施形態では2 つの中間導電層4 を、また、第2 実施形態では2 つの中間導電層4 を、また、第2 実施形態では2 つの中間導電層4 を、また、第2 実施形態では2 つの中間導電層4 を、また、第2 大部形態では2 つの中間導電層4 を の の の 範囲内であれば任意である。

【0049】また、有機層5の層構成については、特に 3 問わないが、陰極と発光層との間に電子注入層を設けた 4 り、陽極と発光層との間に正孔注入層を設けたり、ある 5 いは、これらの電子注入層および正孔注入層を両方に設 6 けた構造でもよく、少なくとも、有機発光層を含む構成 20 7 であればどのような層構成でもよい。 1

# [0050]

【発明の効果】本発明の有機EL発光素子によれば、透明電極と対向電極との間に、中間に中間導電層を挟んで複数の有機発光層を介在させた構成であるから、従来の素子に比べ、走査線電流を抑制できるとともに、応答性を向上させることができる。従って、この有機EL発光

素子を用いた発光装置によれば、大型かつ高精細ディス プレイを安価に実現できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の発光装置の第1実施形態の原理を示す 斜視図である。

【図2】同上実施形態の断面を示す断面図である。

【図3】図2の部分拡大図である。

【図4】本発明の発光装置の第2実施形態の原理を示す 斜視図である。

10 【図5】本発明の第1実施形態の製造方法を説明するための図である。

【図6】従来のXYマトリックス型発光装置を示す平面 図およびその一部拡大斜視図である。

#### 【符号の説明】

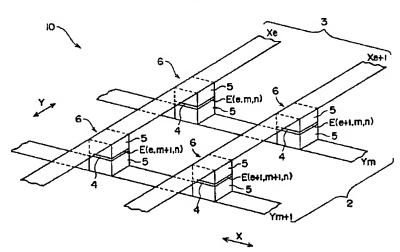
- 2 透明電極
- 3 対向電極
- 4 中間導電層
- 5 有機層
- 6 有機発光素子
- 7 層間絶縁膜
- 10 発光装置
- 20 発光装置

Ym, Ym+1…Y電極ライン

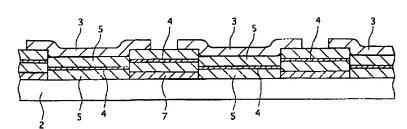
Xe, Xe+1…X電極ライン

E (e, m, n) …E (e+1, m+1, n) …中間導 電層

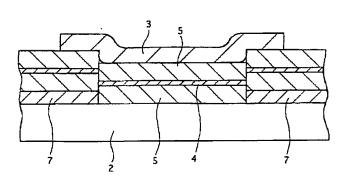
【図1】



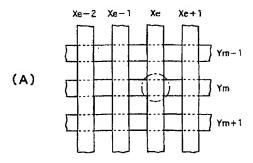
[図2]

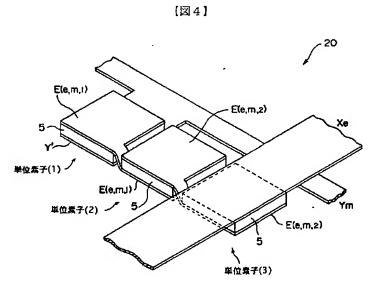


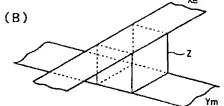
[図3]



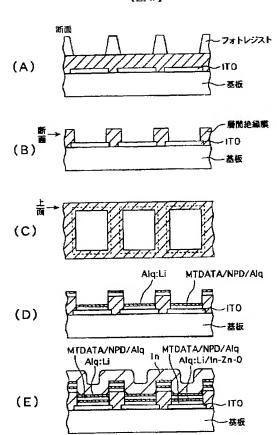
[図6]







[図5]



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)